

第98回分析基礎セミナー

プロに学ぶ・薄膜、界面測定

【日時】 2015/11/18 (水) 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・工学部第4講義室 (西講義棟3階)

【主催】 九州大学中央分析センター

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社日立ハイテクサイエンス、株式会社島津製作所、
株式会社堀場製作所

13:00-14:00 「走査型プローブ顕微鏡による薄膜測定」

走査型プローブ顕微鏡 (SPM) を用いて、ナノメートルスケールで薄膜の表面粗さや膜厚を計測した事例や、有機薄膜のラメラ結晶の観察と結晶形態が及ぼす相転移への影響などについて研究例を紹介いたします。

14:00-15:00 「レーザー顕微鏡による薄膜・界面へのアプローチ」

レーザー顕微鏡は405nmのレーザー光を試料に照射し、共焦点光学系により表面形状を高分解能で三次元観察できる装置です。今回はレーザー顕微鏡の最新技術と、薄膜への応用例についてご紹介いたします。応用例では表面形状観察以外に、レーザー顕微鏡ならではの透明膜の表面・内部・界面のデータをご紹介します。

15:10-16:10 「分光エリプソメトリーによる薄膜測定」

分光エリプソメトリーは薄膜材料の膜厚、屈折率、消衰係数を、非破壊、非接触で測定することができる分析手法です。本セミナーでは分光エリプソメトリーの基礎、原理、解析、応用例について説明いたします。

16:20-17:00 「分光エリプソメトリー・実機によるデモ測定」

ウエスト3号館206室に移動して、実際の測定手順を説明し、デモ測定を行います。

今年度の分析基礎セミナーは、過去に好評を博した「プロに学ぶ」シリーズです。機器メーカーならではのプロフェッショナルな内容にご期待ください。今回は異なる分析手法による薄膜、界面測定について知識が得られる内容です。学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力をお願いします。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 TEL092-802-2857
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp